



# Chemical highly accurate Mechanical Planarizer **ChaMP**



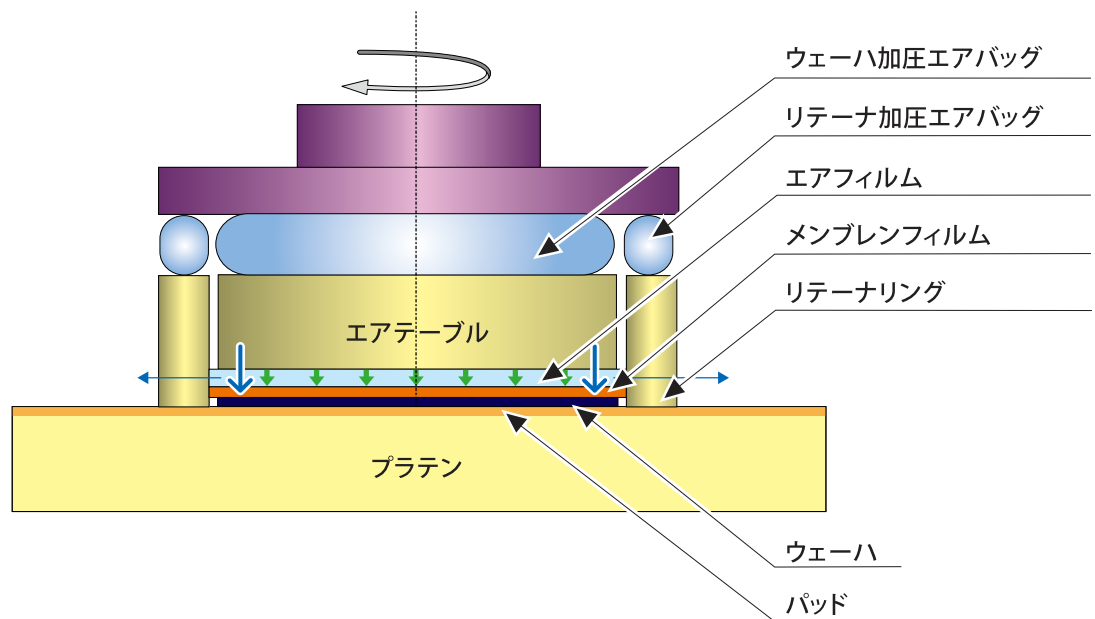
株式会社東京精密

# ChaMP

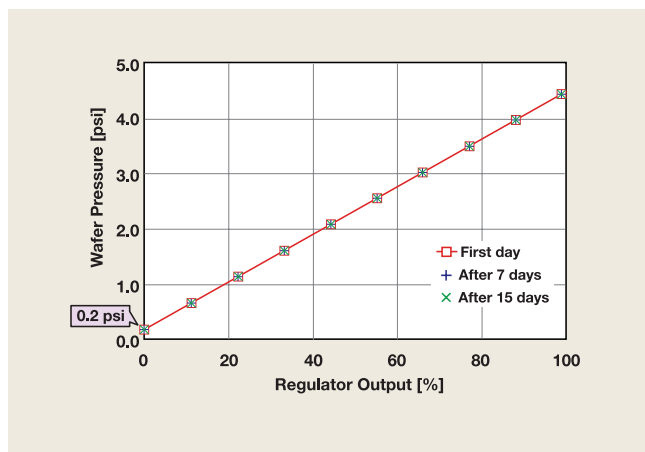
東京精密は、これまで培ってきた精密計測機器及び半導体製造装置の技術を融合し、デザインルール90nmそして65nmのデバイスで要求されるプロセス性能に十分に応えると共に、量産工場における要求にも応えた300mmウェーハ対応CMP装置 ChaMP シリーズを提供いたします。

## エアフロート式ヘッド "Sylphide"

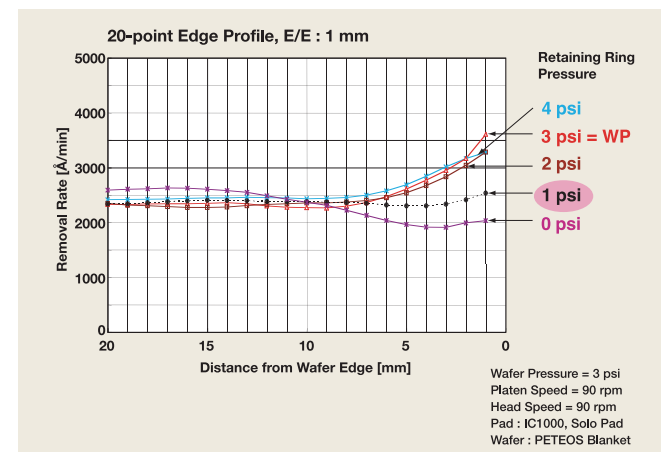
- エアフィルムによる均一な加圧で、表面基準研磨を実現しました。
- エアフィルムと独立したエアバックでウェーハ加圧するため、特に低圧領域での制御性、安定性が良好です。
- ゾーン制御も可能です (オプション)。



## ウェーハ加圧の制御性と再現性



## エッジ1mmまで均一に！！



## 65nm~45nm対応量産プロセスに向けて

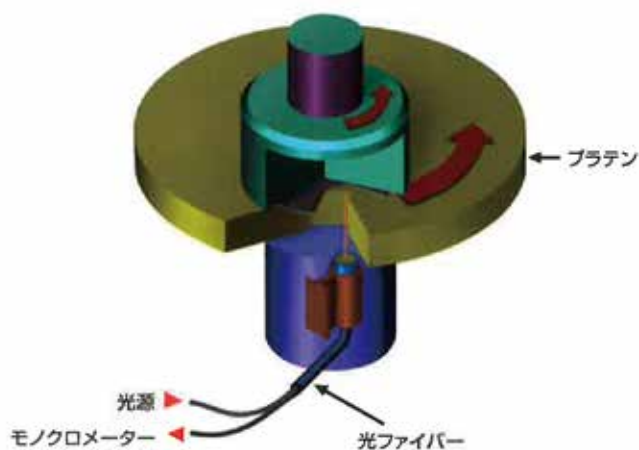
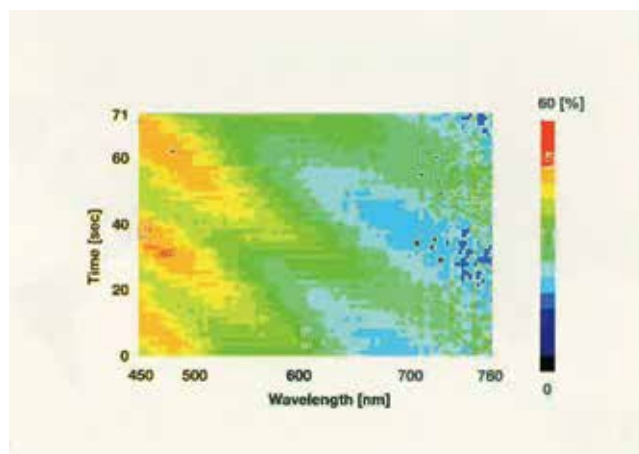
### Low-k 対応洗浄技術



### 生産効率向上、コスト低減に向けたロードマップ



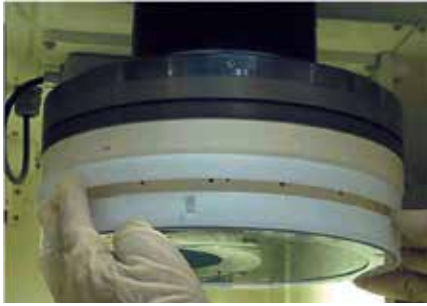
### 光学式終点検出機構



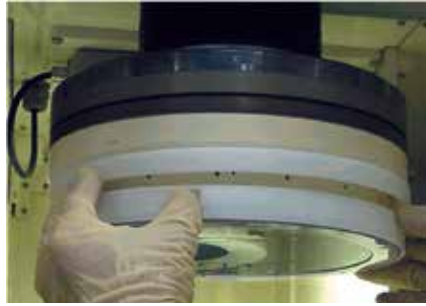
# メンテナンスが簡単な研磨ヘッド：研磨ヘッドの交換は不要、1分でメンテナンス完了

簡単なリテーナ・メンブレンの交換作業は装置の停止時間を大幅に低減します。

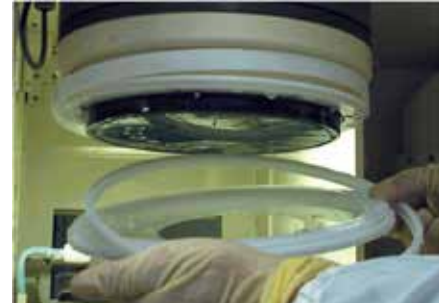
## 取り外し：およそ5秒



両手でスナップリングカバーを上にはずらす



スナップリングを親指で広げる  
リテーナは落ちる



リテーナが外れたところ

## 取り付け：およそ10秒

- 両手でスナップリングを持ちつつリテーナをキャリアに押し付け、少し回して位置決めピンが入る位置で面を合わせる。
- スナップリングを全周に取り付け、カバーを降ろすだけ。



標準モデル

**ChaMP-232**

200mm/150mm/100mm ウェーハ対応

**ChaMP-332**

300mm ウェーハ対応

- 3 プラテン 2 ヘッド構成によりあらゆるアプリケーションに対応しています。
- 300mm/200mm/150mm/100mm ウェーハ対応機は 全て同一コンセプトの研磨ヘッドと EPD システムを搭載しています。

株式会社東京精密

お問合せはお近くの取扱店まで

<http://www.accretech.jp/>

### ■ 半導体製造機器取扱営業所

東京営業所	(042) 631-5211	(042) 631-5234
大阪営業所	(06) 6821-0361	(06) 6821-0210
九州営業所	(097) 538-1985	(097) 538-1989

### ■ 半導体製造機器サービスステーション

仙台出張所	(022) 224-0177	(022) 224-7083
山形出張所	(023) 631-5125	(023) 625-4129
鶴岡出張所	(0235) 29-8020	(0235) 29-8022
東京 C E 課	(042) 642-0358	(042) 642-0367
東京 CE 課/土浦出張所	(0298) 34-8550	(0298) 31-6808
四日市出張所	(0593) 61-6610	(0593) 66-2210
北陸出張所	(076) 422-6756	(076) 422-6757

大阪 C E 課	(06) 6821-0225	(06) 6821-0210
東広島出張所	(082) 493-5618	(082) 493-5619
熊本出張所	(096) 387-5188	(096) 386-1592
九州 C E 課	(097) 534-3291	(097) 538-1989
国分出張所	(0995) 43-2510	(0995) 43-2586
八王子パーツセンター	(042) 642-0381	(042) 642-0397

### ■ 東精エンジニアリング

土浦事業所 CE グループ	(029) 830-1882	(029) 830-1881
土浦事業所 パーツセンター	(029) 830-1882	(029) 830-1881
名古屋事業所	(0561) 32-3605	(0561) 34-2744